

○経済産業省令第五十一号

外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六十九条の五、輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第四条第一項第三号イ、同号ハ、第四号イ、同号ハ及び別表第一並びに外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）第十七条第五項及び別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令等の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十五年九月二十七日

経済産業大臣 茂木 敏充

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令等の一部を改正する省令

（輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部改正）

第一条 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省令第四十九号）の一部を次のように改正する。

第一条第四号中「人造黒鉛」を「一キログラム以上の人造黒鉛」に改め、同条第八号イ中「から（四）までのすべて」を「及び（二）」に、同号イ（一）中「二、〇〇〇ヘルツ以下の出力を得ることができるもの」を「のもの」に改め、同号イ（二）から（四）までを削り、同号イ（二）として次のように加える。

（二） 出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの

第一条第八号ロ中「周波数変換器」を「可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器」に、「（四）までのすべて」を「（三）までの全て」に、「を除く」を「及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であつて、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の（一）から（三）までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く」に改め、同号ロ（一）中「四〇ワット」を「出力が三相以上のものであつて、四〇ボルトアンペア」に改め、同号ロ（二）中「出力が三相以上のものであつて、周波数が」を削り、「超二、〇〇〇ヘルツ未満の出力を得ることができるもの」を「以上の出力周波数で作動するもの」に改め、同号ロ（三）及び（四）を削り、同号ロ（三）として次のように加える。

(三) 出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの

第一条第十号ロ(三) 2中「断面積が〇・七八五平方メートル」を「内径が三〇センチメートル」に、「長さが五メートル」を「有効長が四メートル」に改め、同号ロ(六)を次のように改める。

(六) 削除

第一条第二十二号ハ中「二、〇五〇メガパスカル」を「一、九五〇メガパスカル」に改め、同条第三十五号ロ中「直径」を「内径」に、「四〇〇ミリメートル」を「六五〇ミリメートル」に、「六〇〇ミリメートル」を「三〇〇ミリメートル」に、「ロータ」を「チューブ」に改め、同条第三十六号イ中「四〇ワット」を「三〇ワット」に改め、同号に次のように加える。

リ 五、〇〇〇ナノメートル超六、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であつて、パルスを発振するように設計したものうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの

(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

(二) 平均出力が二〇〇ワットを超えるもの

(三) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの

第一条第三十七号ト中「磁石又は四重極を用いたものであって、」を削り、同号ト(一)中「を超える」を「以上の」に改め、「することができるもの」の下に「であって、原子質量単位での分解能が三二〇を超えるもの」を加え、同号ト(二)中「ニクロム若しくはモネルで構成され、若しくは裏打ちされたもの又はニッケルで被覆されたもの」を「ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセント以上のニッケル銅合金又はニッケルクロム合金で作られた又はこれらの材料で保護されたもの」に改める。

第一条第三十八号イを次のように改める。

イ 絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの

(一) アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたセンサを用いたもの

(二) センサを密閉するために必要不可欠であり、内容物と直接接触し、アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたシールを用いたもの

(三) 次のいずれかに該当するもの

1 フルスケールが一三キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス一パーセント未満のもの

2 フルスケールが一三キロパスカル以上であるとき、一三キロパスカルにおいて、精度がプラスマイナス一三〇パスカル未満のもの

第一条第四十号の次に次の一号を加える。

四十の二 スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの
うち、次のイからハまでの全てに該当するもの

イ 吸気量を一時間あたり五〇立方メートル以上とすることができるもの

ロ 圧力比を二以上とすることができもの

ハ プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(一) アルミニウム又はアルミニウム合金

(二) 酸化アルミニウム

(三) ステンレス鋼

(四) ニッケル又はニッケル合金

(五) 磷^{りん}青銅

(六) ふっ素重合体

第二条の二第一項第一号中「アフリカ豚コレラウイルス」の下に「、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス」を加え、「、ポテト・アンデアン・ラテント・チモウイルス」を削除し、同項第二号中「であつて」の下に「、アルゲンチネンス菌」を加え、「腸管出血性大腸菌血清型〇一五七」を「腸管出血性大腸菌（血清型〇二六、〇四五、〇一〇三、〇一〇四、〇一一一、〇一二一、〇一四五及び〇一五七）」に

改め、「発疹チフスリケツチア」の下に「、バラチ菌」を、「ブタ流産菌」の下に「、ブチリカム菌」を加え、同項第三号中「黄色ブドウ球菌毒素」の下に「（腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）」を加え、同項第五号中「コレトリウム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス」を「コレトリウム・カーハワイ、ザントモナス・アクソノポデイス・パソバー・シトリ」に改め、「ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、ピリキュラリア・オリゼ、ピリキュラリア・グリセア、プクシニア・グラミニス」を「シンキトリウム・エンドビオチウム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、プクシニア・グラミニス種グラミニス・バラエティー・グラミニス」に改め、「プクシニア・ストリイフォルミス」の下に「、ペロノスクレロス ポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ」を加え、「ラルストニア・ソラナセアルム・レース二及び三」を「ラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二」に改め、同条第二項第五号の次に次の一号を加える。

五の二 噴霧乾燥器であつて、次のイからハまでの全てに該当するもの

イ 水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの

ロ 平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの

ハ 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの

第三条第六号の二中「日本工業規格 B 一五一四号（転がり軸受の精度）」を「日本工業規格 B 一五一四号（転がり軸受の公差―第一部…ラジアル軸受）」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第七号ホ中「球形」の下に「又は回転楕円体」を加え、同号ヘ中「合金」の下に「の粉末状のもの」を、「であって、」の下に「篩^{ふるい}、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した」を加え、「粉末状のもの」の下に「篩^{ふるい}、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した」を加え、「粉末状のもの」の下に「篩^{ふるい}、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した」を加え、「粉末状のもの」の含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上」に改め、同号ト中「合金」の下に「の粉末状のもの」の含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上」に改め、同条第十九号に次のように加える。

ニ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ（ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む

む。

第三条第二十五号中「風洞」を「空気力学試験装置」に改め、同号口中「限る。」の下に「マッハ数が三以下で、かつ、測定部断面の長さが二五〇ミリメートル以下の風洞を除く。」を加える。

第五条第一号イ中「日本工業規格 B 一五一四号（転がり軸受の精度）」を「日本工業規格 B 一五一四—一号（転がり軸受—軸受の公差—第一部：ラジアル軸受）」に改め、同条第二号イ（一）及びロ（一）中「〇・〇〇四五ミリメートル」を「〇・〇〇〇三ミリメートル」に改め、同号ロ（二）を次のように改める。

（二） 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

- 1 国際規格 ISO 二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に、移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が 0.003 ミリメートル以下のもの

- 2 国際規格 ISO 二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に、移動量が一メートル以上二メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の直線軸の位置決め精

度が 0.0045 ミリメートル以下のもの

3 国際規格 ISO 230/2 (2006) で定める測定方法により測定した場合に、移動量が二メートル以上の直線軸のうち、ミリメートルで表したいずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が、次の式により算出した数値以下のもの

$0.0045 + 0.007 \times (L - \text{メートルで表した直線軸の移動量}) - 2$

4 パラレルメカニズムのもの

第五条第二号ロ (三) 中「とき」を「場合に、いずれか一軸以上の」に改め、同号へ (五) の次に次のように加える。

(六) 義歯

第五条第三号中「又はこれらの部分品」を削り、同条第七号を次のように改める。

七 別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であつて、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うものうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品

第六条第一号ト(一)中「最大」を「シングルエンド方式の最大」に、「二〇〇を超えるもの」を「五〇〇以上のもの」に改め、同号ト(二)を次のように改める。

(二) シリアルトランシーバーの最大データ速度の総計が一秒あたり二〇〇ギガビット以上のもの

第六条第二号ハ(四)中「三七・五ギガヘルツ」を「三七ギガヘルツ」に改め、「ナノワット」の下に「(マイナス七〇デイービーエム)」を加え、同号ハ(五)中「三七・五ギガヘルツ」を「三七ギガヘルツ」に、「〇・二五ワット(二四デイービーエム)」を「一・〇ワット(三〇デイービーエム)」に改め、「のうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの」を削り、同号ハ(六)中「を超え、」を「超七五ギガヘルツ以下であつて、」に、「〇・一ナノワット」を「三一・六二ミリワット(一五デイービーエム)」に改め、「を超えるもの」の下に「のうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの」を加え、同号ハに次のように加える。

(七) 動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であつて、平均出力値が一〇ミリワット(一〇デイービーエム)を超えるものうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パー

セントを超えるもの

- (八) 動作周波数が九〇ギガヘルツを超え、平均出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇デシベールエム）を超えるもの

第六条第二号ヲ（一）及び（二）中「キロヘルツ未満」の下に「のいずれかの周波数帯域」を加え、同号ワ（一）中「三一・二ピコ秒」を「一五六ピコ秒」に改め、同号ワ（二）中「三・二ギガヘルツ」を「四・八ギガヘルツ」に改め、同号ワ（六）及び（七）中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同条第十二号イ中「無線周波数分析器であつて、」を削り、同号ロ中「無線周波数分析器であつて、」を削り、「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ハ中「無線周波数分析器であつて、七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ 次の（一）及び（二）に該当するもの

- (一) 実時間帯域幅が八五メガヘルツを超えるもの
- (二) 一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの

第六条第十二号に次のように加える。

ホ 周波数マスクトリガー機能を有するものであつて、一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えることができるもの

第六条第十三号イ及びロ中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ハ（一）を次のように改める。

（一） 削除

第六条第十三号ハ（二）中「三・二ギガヘルツ」を「四・八ギガヘルツ」に改め、同号ハ（六）中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ニ（一）及び（二）中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、「キロヘルツ未満」の下に「のいずれかの周波数帯域」を加え、同号ホ中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同条第十四号イ中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ロ中「七〇ギガヘルツ」を「一一〇ギガヘルツ」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イの次に次のように加える。

ロ 七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一ミリワ

ット（〇ディービーエム）を超えるもの

ハ 五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの（イ又はロに該当するものを除く。）

第六条第十五号イ中「七〇ギガヘルツ」を「一一〇ギガヘルツ」に改め、同条第十七号イ（二）中「第二十号又は第二十一号に該当する材料を化学的に反応させることにより化合物半導体の結晶を」を「アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒^ひ素、燐^{りん}、アンチモン又は窒素のいずれか二以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル」に改め、同号ロ（一）を次のように改める。

（一） 削除

第六条第十七号ロ（二）を次のように改める。

（二） 水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビームエネルギーが二〇キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が一〇ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したものの

第六条第十七号ロ（四）を次のように改める。

(四) 加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合において、ビームエネルギーが六五キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が四五ミリアンペア以上のもの

第六条第十七号ロに次のように加える。

(五) 六〇〇度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合において、ビームエネルギーが二〇キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が一〇ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの

第六条第十七号ト中「又はレチクル」を削り、同号ト(二)を次のように改める。

(二) 位相シフト膜を有する多層マスクであつて、次のいずれかに該当するもの(一)に該当するもの及び第一号から第八号の三までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。

1 複屈折率が七ナノメートル毎センチメートル未満のガラスを用いたマスク基板材料から製造されたもの

2 光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるように設計したもの

第六条第十七号ト(三)を削り、同号チを同号ヌとし、同号トの次に次のように加える。

チ レチクルであつて、第一号から第八号の三までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

リ インプリントリソグラフィテンプレートであつて、第一号から第八号の三までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

第六条第十九号イ中「ポジ形」を削り、「二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計した」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号イに次のように加える。

(一) 一五ナノメートル以上二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように

設計したポジ型レジスト

(二) 一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計し

たレジスト

第六条第十九号ロ中「マイクロクローン」を「マイクロクローン」に改める。

第六条第十九号ハを次のように改める。

ハ 削除

第六条第十九号ニ中「(シリル化したレジストを含む。)」を削り、第七条第三号ル中「(五の五)」を「(五の四)」に改め、第八条第一号中「監視用の方向探知機」の下に「無線通信傍受装置」を、「通信妨害装置、」の下に「無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置又は」を加え、「又は無線通信傍受装置」を削り、同条第五号の三を次のように改める。

五の三 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

イ 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置

ロ 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置

ハ 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの

(一) 無線アクセスネットワークの機能を装うもの

(二) 使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの

(三) 使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの(二)に該当するものを除く。

ニ イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置

第八条第五号の五を削り、同条第六号中「試験装置若しくは修理用の装置」を「若しくは試験装置」に改め、同条第七号中「第五号の五」を「第五号の四」に、「試験装置若しくは修理用の装置」を「若しくは試験装置」に改め、同条第九号イ中「又はデジタル署名」を「デジタル署名又は複製することを防止されたプログラムの実行」に改め、同号カ中「又は」を「若しくは」に改め、「限定されているもの」の下に「又は八以上のデバイスに相互接続することができないものであって、当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が一〇〇メートルを超えない範囲に限定されているもの」を加え、第九条第一号イ(一)2中「一及び二」を「いずれか」に改め、同号イ(一)2の一中「したものを」の下に「であって、走査効率が三、八〇〇を超えるもの」を加え、同号イ(一)2の二を次のように改める。

二 次のイからニまでの全てに該当するもの(一に該当するものを除く。)

イ 一〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの

ロ 垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したもの

ハ 動作周波数が三五〇キロヘルツ未満のもの又はセンサーから二〇〇メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの

ニ 次の(一)から(三)までの全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの

(一) センサーの動作

(二) 走査に用いる音波の状態

(三) センサーが感知する音波の速度

第九条第一号イ(一) 3中「及びニ」を「から三までの全て」に改め、同号イ(一) 3の二中「進行方向の分解能及び進行方向に直交する方向の分解能がともに」を「進行方向の分解能が」に改め、「状態で」の下に「作動することができる最大レンジで」を加え、「五七〇平方メートル毎秒」を「一秒あたり五七〇平方メートル」に改め、同号イ(一) 3に次のように加える。

三 進行方向に直交する方向の分解能が一五センチメートル未満のもの

第九条第十号イ(二)及び(三)中「五二〇ナノメートル」を「五一〇ナノメートル」に改め、同号イ(六) 1中「次のいずれかに該当する」を「定格出力が二〇〇ワットを超える」に改め、同号イ(六) 1の一及び二を削り、同号ロ(二)及び(三)中「五二〇ナノメートル」を「五一〇ナノメートル」に改め、同号ニ(六)中「ネオジウムガラスレーザー発振器(連続してパルスを発振するものを除く。)」を「非線返しパルスを発振するネオジウムガラスレーザー発振器」に改め、同条第十六号ニ中「固体の」を削り、「電気光学材料」の下に「又は非線形光学材料」を加え、同号ニに次のように加える。

(四) リン化亜鉛ゲルマニウム

(五) セレン化ガリウム

第九条第十六号ホ中「(一)及び(二)」を「いずれか」に改め、「するもの」の下に「(二)に該当するものを除く。」を加え、同号ホ(一)中「三次の」を「動的な三次の非線形」に改め、「以上」の下に「であって、応答時間が一ミリ秒未満」を加え、同号ホ(二)を次のように改める。

(二) メートル毎ボルトで表した二次の非線形感受率が一兆分の三三以上のもの

第九条第十六号リ中「次のいずれかに該当するもの」を「チタンを添加したサファイア」に改め、同号

リ(一)及び(二)を削る。

第十条第一号イ(二) 1中「〇・〇四九〇五メートル」を「〇・〇一二二六二五メートル」に改め、同号イ(二) 2中「〇・二五パーセント」を「〇・一二五パーセント」に改め、第十四条第五号の二を次のように改める。

五の二 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)

ロ イに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置

第十四条の二を削り、第十五条第一項第二号中「第一条」の下に「第八号ロ、」を加える。

第十五条第一項に次の二号を加える。

六 周波数変換器(第一条第八号ロに該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

七 第一条第八号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム

第十八条第一項第一号イ中「ときの」を「場合に、いずれか一軸以上の」に、「〇・〇〇三六ミリメートル」を「〇・〇〇三ミリメートル」に改め、同号ロ（一）中「ときの」を「場合に、いずれか一軸以上の」に、「〇・〇〇三六ミリメートル」を「〇・〇〇三ミリメートル」に改め、同号ロ（二）中「輪郭制御をすることができ軸数が五以上の」を「第五条第二号ロ（二）1から3までのいずれかに該当する」に、「ときの」を「場合に、いずれか一軸以上の」に、「〇・〇〇三六ミリメートル」を「〇・〇〇三ミリメートル」に改め、同条第二項中「第五条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。

一 第五条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

二 第五条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであつて、工作物を任

意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの

三 前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

第十八条第三項第五号中「もの」を「非電子的基板用コーティング技術」に改め、「技術」を「もの」に改める。

第十九条第二項中「イからへまでのいずれか又はチ」を「イからへまで又はヌのいずれか」に改める。

第二十条第一項第七号を次のように改める。

七 削除

第二十条第一項第八号中「前号まで」を「第六号までのいずれか」に改め、第二十一条第一項第二号、第四号、第六号及び第八号中「第五号の五」を「第五号の四」に改め、同条第三項第四号中「三七・五ギガヘルツ以下のもの」を「三七ギガヘルツ以下であつて、平均出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇デシービーエム）を超えるもの」に改め、同項第五号中「三七・五ギガヘルツ」を「三七ギガヘルツ」に改め、「〇・二五ワット（二四デシービーエム）」を「一・〇ワット（三〇デシービーエム）」に改め、同項

第六号中「を超えるもの」を「超七五ギガヘルツ以下であつて、平均出力値が三一・六二ミリワット（一五デイベービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの」に改め、同項に次の二号を加える。

七 動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であつて、平均出力値が一〇ミリワット（一〇デイベービーエム）を超えるものうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの

八 動作周波数が九〇ギガヘルツを超えるものであつて、平均出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇デイベービーエム）を超えるもの

第二十二條第一項第四号中「第一号イ（六）」を削り、同項第五号中「第十号」を「第十号の二」に改め、第二十三條第三項第二号中「設計の」を削り、「限る。」の下に「であつて、第四号ロからへまで又は第五号イからへまでのいずれかに該当するものの設計に係る技術（プログラムを除く。）を用いたもの」を加え、同号イ中「経路を最適化」を「の全行程を管理」に改め、同号ホを次のように改める。

ホ 削除

第二十三条第三項第三号を次のように改める。

三 削除

第二十三条第三項第五号イからニを次のように改める。

イ 航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術（プログラムを除く。）であつて、フライバイライト方式のアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの

ロ 削除

ハ アクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム

ニ アクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム

第二十三条第三項第五号ホ中「経路を最適化」を「の全行程を管理」に改め、第二十五条第一項第一号中「又は製造」を削り、同号の次に次の一号を加える。

一の二 第十二条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術（プログラムを除く。）

第二十五条第三項第二号ニ中「一、三七〇度」を「一、四二〇度」に改め、「よどみ点」を削り、「使用する事ができる」を「作動するように設計した」に改め、同号ル中「次のいずれかに該当」の下に「する」を加える。

第二十六条に次の一号を加える。

三 プログラムであつて、当該プログラムを用いることによつてのみ、ある貨物が第十三条第十項に該当する貨物の有する機能を發揮できるように特に設計したもの

第二十八条を次のように改める。

第二十八条 外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関稅定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

別表第二中「マルタ」の下に「メキシコ」を加え、別表第三中「別表第三（第十八条關係）」を「別

表第三（第五条、第十八条関係）」に改め、別表第三の三の項のコーティング法の欄中「定着させる方法」の下に「（イオンプレーティング法）」を加える。

（貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正）

第二条 貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成十年通商産業省令第八号）の一部を次のように改正する。

第九条第二項第七号中「一六の項（一）」を「一六の項」に改め、「及び次号」を削り、同項第八号を次のように改める。

八 削除

第九条第二項第十四号に次のように加える。

ホ 令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるプログラム（オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）の取引であつて、既に輸出した貨物（輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。）の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引（輸出の許可を受けた

日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能、特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能、特性を提供するものを除く。）

へ 令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるプログラム（オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）の取引であつて、既に提供したプログラム（令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。）のインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該提供したプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引（役務取引の許可を受けた日又は当該提供したプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供プログラムの性能、特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供プログラムに対して新たな機能、特性を提供するものを除く。）

第九条第二項に次の一号を加える。

十六 暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であつて、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの

(輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部改正)

第三条 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

本文中「及び第四号イ」を削り、別表第四号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改め、同表第五号中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。

(輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部改正)

第四条 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号)の一部を次のように改正する。

本文中「及び第四号ハ」を削る。

附 則

(施行期日)

1 この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。